Communiqué de presse

N° 647f

**Maîtrise des tâches de mesure dans le vide**

**Les tâches de mesure dans le vide posent des exigences très élevées à la technologie de capteur utilisée. C’est précisément dans ce domaine que la technique de mesure précise de Micro-Epsilon fait valoir ses atouts : fiables, sans contact et stables, les capteurs fournissent des données exactes dans de nombreuses classes de vide. Selon les exigences, les capteurs peuvent être configurés de manière spécifique à l’application et adaptés de manière optimale aux conditions respectives.**

Dans l’industrie des semi-conducteurs, l’optique ou l’aéronautique, les mesures dans des conditions de vide font partie du quotidien, tout en posant des exigences très élevées aux capteurs. Micro-Epsilon propose à cet effet aussi bien des capteurs de catalogue que des capteurs spécialement conçus fonctionnant de manière fiable et extrêmement précise dans des conditions extrêmes. Grâce à leurs matériaux adaptés et à leur conception optimisée, ils fonctionnent directement dans le vide ou mesurent de l’extérieur à travers des fenêtres à vide.

Selon l’application, on utilise des capteurs optiques, inductifs, capacitifs ou interférométriques. Ainsi, les capteurs laser de la série optoNCDT sont idéaux pour mesurer les distances dans des processus tels que le soudage laser ou la fabrication additive. Pour des mesures d’épaisseur au nanomètre près sur des wafers ou des écrans, les capteurs confocaux de la série confocalDT sont le premier choix. Les interféromètres absolus fournissent des mesures de distance et d’épaisseur de haute précision entre autres dans la fabrication de semi-conducteurs.

Les capteurs inductifs basés sur les courants de Foucault de la série induSENSOR, les capteurs capacitifs capaNCDT et les capteurs magnéto-inductifs mainSENSOR offrent des solutions supplémentaires pour les applications sous vide exigeantes, par exemple dans l’industrie aéronautique.

Tous les capteurs sont fabriqués selon les normes les plus strictes et sont régulièrement contrôlés (par exemple, échantillonnage TENAX).  Grâce à leurs formes compactes, à leurs contrôleurs intégrés et à leurs interfaces intelligentes, ils s’installent rapidement et s’intègrent de manière flexible dans les systèmes existants. Micro-Epsilon propose la technique de mesure adaptée à chaque application sous vide : sur mesure et prête à l’emploi.

*env. 2.300 caractères*

(PR647\_Vakuum Portfolio.jpg)

